شرکت (دانش بنیان تولیدی)
توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه

Mask Aligner
MA-210405

دستگاه تطبیق ماسک مدل MA-210405 اولین سری از دستگاه های لیتوگرافی با قابلیت تطبیق ماسک و نمونه، از بالا است.

- **قابلیت تطبیق ماسک و نمونه با دقت ۲ میکرون از بالا**
- **محدوده جابجایی نمونه، برای تطبیق بین ماسک و نمونه**

x , y : ± ۷,۵ mm
z : ± ۱۵ mm

- **طراحی ویژه نگهدارنده نمونه با قابلیت استفاده برای ویفرهای با اندازه های از ۰,۵ تا ۴ اینچ**
- **سه صفحه نگهدارنده ماسک با ابعاد متفاوت جهت استفاده از ماسک‌های با ابعاد ۱، ۲ و ۴ اینچ**
- **نوردهی ماورابنفش با توان ۵۰ وات**
- **استفاده از میکروسکوپ دیجیتال تا بزرگنمایی ۲۰۰ برای مشاهده سطح ماسک یا نمونه**
- **جابجایی قسمت اپتیک و موقعیت لنزها با جوی‌استیک**
- **سرعت جابجایی میکروسکوپ از mm/s(۵-۱) براساس میزان انحراف دسته جوی استیک**
- **قابلیت لیتوگرافی برای ماسک های تا ابعاد mm۱۰۰ * ۱۰۰**

Technical data: AMS Mask Aligners

FEATURES		MA-210405
Sample size (inch)		0.5-1-3-4 inch
Mask size (inch)		1-2-4
Exposure System	wavelength	390–410nm
	power	UV-Vis1000
	Beam size	5 inch
Minimum Feature size		4µm
Alignment methods		Top-side (TSA)
XY- alignment stage resolution		2µm
Alignment range	X	±12.5
	Y	±12.5
	Z	±25
	θ	±15 deg
Scanning movement XY(mm*mm)		80*80
TSA microscope stage (joystick	Fullfield XY(mm*mm)	100*100
	Lens	2X
	scanning speed (Joystick)	1-5 mm/s
Maximum Mask size (mm×mm)		100*100
Working distances		1-4 cm
Vacuum chunk for samples		0.5-1-3-4 inch
Mask and sample holding mechanism		Solid
Anti-vibration platform		Damping base
PC and software		Display